

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2004年7月29日 (29.07.2004)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2004/062816 A1

- (51) 国際特許分類: B05D 5/06  
(21) 国際出願番号: PCT/JP2003/000308  
(22) 国際出願日: 2003年1月16日 (16.01.2003)  
(25) 国際出願の言語: 日本語  
(26) 国際公開の言語: 日本語  
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社日本吸収体技術研究所 (JAPAN ABSORBENT TECHNOLOGY INSTITUTE) [JP/JP]; 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町二丁目2番5号 Tokyo (JP). 株式会社ヒラノテクシード (HIRANO TECSEED CO., LTD.) [JP/JP]; 〒636-0051 奈良県北葛城郡河合町川合101-1 Nara (JP).  
(72) 発明者; および  
(73) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 鈴木 磨

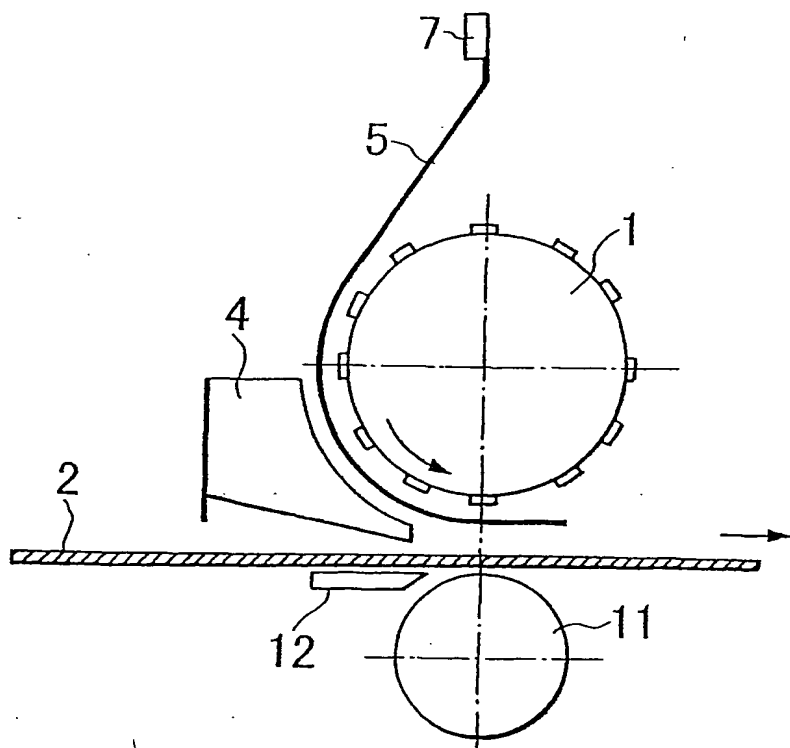
(SUZUKI, Migaku) [JP/JP]; 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町二丁目2番5号 株式会社日本吸収体技術研究所内 Tokyo (JP). 小林 東亜 (KOBAYASHI, Toa) [JP/JP]; 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町二丁目2番5号 株式会社日本吸収体技術研究所内 Tokyo (JP). 森谷 麗子 (MORIYA, Reiko) [JP/JP]; 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町二丁目2番5号 株式会社日本吸収体技術研究所内 Tokyo (JP). 若林 悟 (WAKABAYASHI, Satoru) [JP/JP]; 〒636-0051 奈良県北葛城郡河合町川合101-1 株式会社ヒラノテクシード内 Nara (JP). 卯川 里志 (UKAWA, Satoshi) [JP/JP]; 〒636-0051 奈良県北葛城郡河合町川合101-1 株式会社ヒラノテクシード内 Nara (JP).

(74) 代理人: 山下 稔平 (YAMASHITA, Johei); 〒105-0001 東京都港区虎ノ門五丁目1番1号虎ノ門4 OMTビル 山下国際特許事務所 Tokyo (JP).

[続葉有]

(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR PATTERN COATING

(54) 発明の名称: パターンコーティング方法および装置



(57) Abstract: A pattern coating method for coating the surface of a sheet-like base material with dispersion slurry having solid SAP distributed in a dispersion medium, comprising the steps of disposing a rotation pattern roll over the sheet-like base material through a cover film and feeding the dispersion slurry between the sheet-like base material and the cover film while rotating the rotation pattern roll, whereby a first area where the coated layer is present thick in irregular pattern on the surface of the sheet-like base material and a second area where the coated layer is present thin or not almost present thereon can be formed by pressing the rotation pattern roll against the coated layer through the cover film when the coated layer of the dispersion slurry is formed.

(57) 要約: 固形状のSAPが分散媒体中に分散している分散スラリーをシート状基材の表面にコーティングするために、該シート状基材の上方に、カバーフィルムを介して回転パターンロールを配置し、該回転パターンロールを回転させながら、該シート状基材と該カバーフィルムとの間に該分散スラリーを供給することにより該分散ス

ラリーの塗布層を形成する際に、該カバーフィルムを介して該回転パターンロールを塗布層に押し付けて、該シート状基材の表面に凹凸パターン状に、該塗布層が厚く存在する第1の領域と、該塗布層が薄く存在するもしくはほとんど存在しない第2の領域とを形成する。



(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許

(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:  
— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。